

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

OBJETIVO DE LA TESIS.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

METODOLOGÍA.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

## CAPÍTULO I

**1. MICROESPEJOS MEMS**.....- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. -

1.1 Microespejos Móviles.....- Error! Bookmark not defined. -  
1.1.1 Dispositivo de Microespejos Digitales .....- Error! Bookmark not defined. -

1.2 Microespejos de Pistón.....- Error! Bookmark not defined. -

1.3 Microespejos deformables.....- Error! Bookmark not defined. -

1.4 Microespejos Torsionales .....- Error! Bookmark not defined. -

## CAPÍTULO II

**2. PROCESOS Y TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DE MICROSISTEMAS**.....ERROR! BOOKM

2.1 Micromaqinado de superficie .....Error! Bookmark not defined.

2.1.1 El silicio como material primordial de las estructuras microelectrónicasError! Bookmark

2.1.2 Proceso de construcción y atacado del silicio al construir un  
microsistema.....Error! Bookmark not defined.

2.1.2.1 Oxidación Térmica .....Error! Bookmark not defined.

2.1.2.1.a) Oxidación térmica húmeda.....Error! Bookmark not defined.

2.1.2.1.b) Oxidación térmica seca.....Error! Bookmark not defined.

2.1.2.2 Depósito .....Error! Bookmark not defined.

2.1.2.2.a) Depósito Físico en Fase Vapor (LPPVD).....Error! Bookmark not defined.

2.1.2.2.b) Depósito Química en Fase Vapor (LPCVD).....Error! Bookmark not defined.

2.1.2.3 Litografía .....Error! Bookmark not defined.

2.1.2.4 Grabado.....Error! Bookmark not defined.

2.1.2.5 Difusión .....Error! Bookmark not defined.

2.1.3 Ventajas principales del proceso de micromaqinado en superficieError! Bookmark not

2.1.4 Procesos MUMPS.....Error! Bookmark not defined.

2.1.4.1 Proceso PolyMUMPS .....Error! Bookmark not defined.

2.2 Micromaqinado en volumen .....Error! Bookmark not defined.

2.3 Proceso LIGA.....Error! Bookmark not defined.

---

## CAPÍTULO III

3. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1 Análisis Teórico De Las Características Estáticas Del Microespejo Torsional .....	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 El Principio Del Capacitor y El Momento Torsional Electrostático.	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Relación Estática Entre El Voltaje De Operación Y El Ángulo De Rotación .....	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Estudio Del Efecto Caída Instantánea .....	Error! Bookmark not defined.
3.1.4 Estudio Del Efecto De Adhesión Momentánea .....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Análisis Teórico de las Características Dinámicas Del Microespejo Torsional .....	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Doblez De Las Vigas Torsionales Debido A La Masa Del Microespejo	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Desplazamiento Angular De Las Vigas Torsionales. ..	Error! Bookmark not defined.
3.2.3 Frecuencia De Vibración Para La Estructura Del Microespejo.	Error! Bookmark not defined.
3.2.4 Frecuencia De Vibración De La Viga Torsional .....	Error! Bookmark not defined.
3.2.5 Diferentes Fuerzas De Amortiguamiento Para El Microespejo Torsional	Error! Bookmark not defined.
3.2.6 Amortiguamiento De la Vibración oscilatoria del microespejo.	Error! Bookmark not defined.
3.2.7 Respuesta Del Microespejo Torsional A Una Fuerza Escalón	Error! Bookmark not defined.
3.3 Acoplamiento Dinámico Entre Los Efectos De Deflexión Y Torsión.	Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Respuesta A Una Fuerza Escalón Del Modelo Con Acoplamiento Dinámico .....	Error! Bookmark not defined.
3.3.1.1 Respuesta A Una Fuerza Escalón Sin Amortiguamiento.	Error! Bookmark not defined.
3.3.1.2 Respuesta Escalón Del Microespejo Con Amortiguamiento Viscoso	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Respuesta armónica del microespejo .....	Error! Bookmark not defined.

## CAPÍTULO IV

4. DISEÑO DEL MICROESPEJO PARA SIMULACIÓN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.1 Especificaciones De Diseño Para El Microespejo .....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Método de Elementos Finitos .....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 División del sistema. ....	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Ecuación de Potencial. ....	Error! Bookmark not defined.
4.2.3 Condiciones de frontera. ....	Error! Bookmark not defined.
4.2.4 Cálculo de los potenciales. ....	Error! Bookmark not defined.
4.2.5 Resolución de las ecuaciones planteadas. ....	Error! Bookmark not defined.
4.2.6 Interpretación de resultados. ....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Simulaciones de Elemento Finito .....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 CoventorWare .....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1.1 Base de datos de Propiedades de los materiales.	Error! Bookmark not defined.
4.3.1.2 Editor de Procesos.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1.3 Arquitecto .....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1.4 Diseñador .....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1.5 Mallado .....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1.6 Analizador .....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1.7 Visualizador .....	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Proceso de Simulación en Coventor Ware .....	Error! Bookmark not defined.
4.3.2.1 Construcción del Modelo .....	Error! Bookmark not defined.

---

4.4 Obtención de resultados .....	Error! Bookmark not defined.
4.4.1 Parámetros utilizados para la simulación .....	Error! Bookmark not defined.
4.4.1.1 Resultados de la simulación del desplazamiento del microespejo	Error! Bookmark not defined.
4.4.1.2 Relación entre los ángulos de desplazamiento y el voltaje aplicado	Error! Bookmark not defined.
4.4.1.3 Resultados de la simulación de fuerza de reacción en las vigas.	Error! Bookmark not defined.
4.4.1.4 Resultados de la simulación de modos de frecuencia de vibración.	Error! Bookmark not defined.

## **CAPÍTULO V**

<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS.....</b>	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.1 Propiedades del polisilicio .....	Error! Bookmark not defined.
5.2 El ángulo de inclinación y la linealidad .....	Error! Bookmark not defined.
5.3 Modos de vibración .....	Error! Bookmark not defined.
5.4 El modelo físico .....	Error! Bookmark not defined.

## **CAPÍTULO VI**

<b>6. CONCLUSIONES .....</b>	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	Error! Bookmark not defined.